

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第6部門第2区分
 【発行日】平成22年7月1日(2010.7.1)

【公開番号】特開2009-31536(P2009-31536A)
 【公開日】平成21年2月12日(2009.2.12)
 【年通号数】公開・登録公報2009-006
 【出願番号】特願2007-195513(P2007-195513)
 【国際特許分類】

G 0 2 B 26/10 (2006.01)
 G 0 2 B 26/08 (2006.01)
 B 4 1 J 2/44 (2006.01)
 H 0 4 N 1/113 (2006.01)
 B 8 1 B 3/00 (2006.01)

【F I】

G 0 2 B 26/10 1 0 4 Z
 G 0 2 B 26/08 E
 B 4 1 J 3/00 D
 H 0 4 N 1/04 1 0 4 Z
 B 8 1 B 3/00

【手続補正書】

【提出日】平成22年5月14日(2010.5.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

表面に光反射層が形成されたミラーと、
 前記ミラーを所定の駆動軸の周りに揺動駆動させる駆動部と、を備え、
 前記ミラーの前記光反射層とは反対側の面に、前記ミラーの構成部材の熱伝導率よりも熱伝導率の高い材質の層が形成されていることを特徴とするスキャナ。

【請求項2】

表面に光反射層が形成されたミラーと、
 前記ミラーを所定の駆動軸の周りに揺動駆動させる駆動部と、を備え、
 前記ミラーの前記光反射層とは反対側の面に、微細な凹凸が形成されていることを特徴とするスキャナ。

【請求項3】

表面に光反射層が形成されたミラーと、
 前記ミラーを所定の駆動軸の周りに揺動駆動させる駆動部と、を備え、
 前記ミラーの光反射層とは反対側の面に、表面に微細な凹凸が形成された層が形成されていることを特徴とするスキャナ。

【請求項4】

前記ミラーの駆動軸上には、前記ミラーを静電駆動するための静電容量素子部が接続され、

前記静電容量素子部の、前記光反射層への光の入射側とは反対側の面に、前記静電容量素子部の熱伝導率よりも熱伝導率の高い材質の層が形成されていることを特徴とする請求項1に記載のスキャナ。

【請求項 5】

前記ミラーの駆動軸上には、前記ミラーを静電駆動するための静電容量素子部が接続され、

前記静電容量素子部の、前記光反射層への光の入射側とは反対側の面に、前記微細な凹凸が形成された層が形成されていることを特徴とする請求項 3 に記載のスキマナ。

【請求項 6】

前記ミラーの前記光反射層とは反対側の面に凹部が形成されていることを特徴とする請求項 1 から請求項 5 のいずれか 1 項に記載のスキマナ。

【請求項 7】

前記微細な凹凸が形成された層は、アモルファスシリコン膜を熱処理して形成されたポリシリコン膜であることを特徴とする請求項 3 または請求項 4 に記載のスキマナ。

【請求項 8】

前記微細な凹凸が形成された層は、カーボンナノチューブを含むことを特徴とする請求項 3 または請求項 4 に記載のスキマナ。

【請求項 9】

前記凹部は、マトリクス状に配列されて形成されていることを特徴とする請求項 6 に記載のスキマナ。

【請求項 10】

前記凹部は、ハニカム状に配列されて形成されていることを特徴とする請求項 6 に記載のスキマナ。

【請求項 11】

前記凹部は、前記駆動軸に対して対称に配置されていることを特徴とする請求項 6 に記載のスキマナ。